キャップ層を用いたアニールによる HfO₂ 膜中歪み操作と強誘電相安定化効果 の面内および面外方向への X 線回折を用いた評価 Changing of structural distortion and stabilization of ferroelectric phase in capannealed HfO₂ thin films characterized by in-plane and out-of-plane XRD 東京大学大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻 ^O籾山陽紀, Siri Nittayakasetwat, 喜多浩之 Dept. of Materials Engineering, The Univ. of Tokyo ^oHaruki Momiyama, Siri. Nittayakasetwat and Koji. Kita E-mail: momiyama@scio.t.u-tokyo.ac.jp

【はじめに】強誘電性 HfO₂薄膜は、分極反転の繰り返しと共に分極の大きさが変動することが指摘されており、強誘電相の構造的安定性の向上が求められる。我々は既に HfO₂薄膜が膜中に大きな構造歪みを内在していることが面内方向と面外方向の XRD ピークのシフトとして検出可能であることを報告している[1]。またメタルキャッピングをはじめキャッピングによる疲労特性の向上の報告が多く上がっている。今回、この構造的歪みに対する HfO₂ 薄膜の膜厚、及びアニール時のキャップ層の種類による影響を系統的に調査した。

【実験方法】化学洗浄を施した p⁺-Ge(001)ウェハ上に HfO₂を RF スパッタリングし,その後赤外 線ランプ炉にて N₂雰囲気下で 600℃30 秒のアニーリングを行った上で,Au 上部電極と Al 下部電 極を蒸着させた。Al₂O₃によるキャップ層を挿入したサンプルでは HfO₂ をスパッタリングした後, その上に 3nm の Al₂O₃ を RF スパッタリングした。

【結果および考察】斜入射の XRD においては X 線侵入長を入射角によって限定することが可能 である。そこで、面内及び面外方向の XRD ピークのシフト量のうち、特に強誘電相を含む o/t/c ピ ーク(斜方晶,正方晶,立方晶を含むピーク)について X 線侵入長依存性を調べた結果を Fig. 1 に示す。表面側・基板側共に面内方向と面外方向に歪みが存在するが、表面側がより顕著に歪ん でいることがわかる。 $\Delta d_{in-out} = d_{spacing,in-plane} - d_{spacing,asymout-of-plane}$ とし、膜厚の異なる 試料で比較すると、12nm 膜厚の試料では 30nm 膜厚の試料よりも全体として歪みが小さい。また Al₂O₃によるキャップ層を挿入した試料と比較すると、歪みは大きくなっていることがわかる。こ のように HfO₂の膜厚やキャッピングの有無などの条件によって Δd_{in-out} の操作ができる。

次に HfO₂薄膜の PV 疲労特性に与えるキャップ層の影響を比較した結果を Fig. 3 に示す。Fig. 3 はスイッチング分極を縦軸にとって絶縁破壊電圧に近いパルスの印加(キャップ層を導入していない試料では 12V、キャップ層を導入した試料では 18V)による疲労を比較している。キャップ 層を導入していない試料と比較して導入した試料では分極が大きく劣化も抑制された。キャップ 層の導入だけで疲労特性は影響を受けており,これが膜内の歪みと関係しているがその相関性は 検討中である。ただしキャップ層を挿入したサンプルでは間隔をあけたパルスの印加を 200 回行 ってから疲労測定を行った結果を示している。

【まとめ】HfO₂薄膜に内在される構造歪みは、基板側よりも表面近傍でより顕在化する。そこで アニール時のキャップ層の導入は効果的に構造歪みを変調させることができ、これが強誘電相の 生成割合の増大や、分極反転の繰り返しによる強誘電性の変動抑制の効果の要因の一つとなるこ とが示唆された。

参考文献 [1] S. Nittakayasetwat and K. Kita, SSDM 2020.



Fig. 1. Penetration depth dependence of In-Plane and Asymmetric Out-ofplane d_{spacing} of o/t/c-phases



Fig. 2. Penetration depth dependence of Δd_{in-out} of o/t/c-phases (Doted lines are guide to the eye)



